

導入年度	R3年度	設備名	非接触ひずみ測定器			
メーカー	GOM (独)	型式	ARAMIS Adjustable 12M	設置室	金属材料試験室	

令和3年度ものづくり支援機能強化事業

《 概要 》

実製品や機械部品等が力や熱などの負荷を受けたときのひずみ分布や変位を、非接触かつ三次元でリアルタイムに測定することが可能な装置です。ひずみは2つのカメラを用い、対象物に塗布したランダムパターン画像等からデジタル画像相関法（DIC）により測定します。

《 装置外観 》



《 仕様 》

- ・測定範囲：35×25 mm～2050×1500 mm
- ・フレームレート：25～100 フレーム/秒
- ・カメラ解像度：4096×3000 ピクセル
- ・ひずみ測定レンジ：0.005～2000 %
- ・解析項目：最大主ひずみ、最小主ひずみ、ミーゼス相当ひずみ、変位等

《 用途例 》

- ・実製品や機械部品等に発生するひずみ分布や変位を測定

最大主ひずみの分布（引張方向のひずみ評価）

